PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-237909

(43)Date of publication of application: 26.08.1992

(51)Int.CI.

H01B 13/00 H01B 5/14

(21)Application number : 03-020469

(71)Applicant: SUMITOMO METAL MINING CO LTD

TOHOKU KAKO KK

(22)Date of filing:

21.01.1991

(72)Inventor: YUKINOBU MASAYA

CHIKUI YASUO

(54) FILM FORMING METHOD FOR TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a transparent conductive film forming method which can improve optical characteristics and electrical characteristics especially of a transparent conductive film. CONSTITUTION: An ultravioletray-setting ink including indium-tin oxide fine particles is printed onto a resin film, subsequently de-solvent treatment is performed by drying, further a rolling process by a steel roller is applied, and is subjected to an ultravioletray-setting so as to form a transparent conductive film on the resin film.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-237909

(43)公開日 平成4年(1992)8月26日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 1 B 13/00

503 B 7244-5G

5/14

A 7244-5G

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平3-20469

(71)出願人 000183303

(22)出顧日

平成3年(1991)1月21日

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋5丁目11番3号

(71)出願人 000221959

東北化工株式会社

宫城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

(72)発明者 行延 雅也

愛媛県新居浜市王子町1-7

(72)発明者 筑井 泰夫

栃木県那須郡南那須町田野倉17

(74)代理人 弁理士 篠原 泰司 (外1名)

(54) 【発明の名称】 透明導電膜の成膜方法

(57)【要約】

【目的】本発明の目的は、特に透明導電膜の光学的特性 及び電気的特性を向上させることができるようにした透 明導電膜の成膜方法を提供することである。

【構成】本発明による透明導電膜の成膜方法は、インジウム錫酸化物微粒子を含む紫外線硬化型インクを樹脂フィルム上に印刷後、乾燥によって脱溶剤化処理を施し、更にスチールロールによる圧延処理後、紫外線硬化処理を施すことにより上記樹脂フィルム上に透明導電膜を形成するというものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 インジウム錫酸化物微粒子を含む紫外線 硬化型インクを樹脂フィルム上に印刷後、乾燥によって 脱溶剤化処理を施し、更にスチールロールによる圧延処 理後、紫外線硬化処理を施すことにより上記樹脂フィル ム上に透明導電膜を形成する透明導電膜の成膜方法。

【請求項2】 上記インジウム錫酸化物微粒子は、平均 粒径が0. 1ミクロンメートル以下であることを特徴と する請求項1に記載の透明導電膜の成膜方法。

【請求項3】 上記紫外線硬化型インクの固形成分中の 10 上記インジウム錫酸化物微粒子の体積含有率が50~8 0パーセントであることを特徴とする請求項1に記載の 透明導電膜の成膜方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、各種のディスプレイ装 置等において透明電極や帯電防止フィルムなどに用いら れる特にインジウム錫酸化物(以下、ITOという)透 明導電膜を形成するための方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、情報表示機器において液晶ディス プレイやエレクトロ・ルミネッセンスディスプレイ等の フラット型ディスプレイ装置が広く用いられている。そ してこの種のディスプレイでは、表示素子の電極又は回 路電極に透明導電膜が使用されるが、かかる透明導電膜 には、抵抗値が小さく且つ透明性が良好であることから 特にIT〇透明導電膜が好適である。

【0003】IT〇透明導電膜を形成する場合、ITO 粒子をターゲットとしてスパッタリングを行うことによ り基板上に透明導電膜を蒸着する方法があるが、この方 30 法で使用する装置は高価であり、大きな蒸着面積の成膜 加工には適していない。又、成膜後更にエッチングによ ってパターン成形加工を行う必要がある等の問題があっ た。そこでITO微粒子粉を用いたインクを塗布又は印 刷することによりIT〇透明導電膜を形成する方法が開 発されてきている。そしてこの方法はITO微粒子粉を 樹脂と溶剤とに混ぜ合わせて均一に分散せしめることに よりペーストを形成し、該ペーストを基板に印刷してか ら乾燥するという成膜方法である(以下、単に塗布法と いう)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記塗 布法により形成される導電膜の導電原理はITO微粒子 相互の接近作用によって行われるものであるため、前記 蒸着による方法に比べて導電膜の電気的抵抗値が大きく なってしまうので問題になっていた。又、導電膜の膜厚 が厚くなる (1~3 µm) 上、導電膜表面の凹凸や導電 膜内部のポイド(空隙)等の原因で光の散乱が発生して 導電膜の全光線透過率やヘーズ値(昼の程度を表す数 値)が悪化するという問題があった。このためかかる塗 50 性は良好であっても電気的特性を向上させることはでき

布法により形成された導電膜は帯電防止用等の比較的グ レードが低い用途以外では実用化されていない。

【0005】本発明はかかる実情に鑑み、この種透明導 電膜の光学的特性及び電気的特性を向上させることがで きるようにした透明導電膜の成膜方法を提供することを 目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明による透明導電膜 の成膜方法は、ITO微粒子を含む紫外線硬化型インク を樹脂フィルム上に印刷後、乾燥によって脱溶剤化処理 を施し、更にスチールロールによる圧延処理後、紫外線 硬化処理を施すことにより行われる。

【0007】又、本発明方法において、上記微粒子は、 平均粒径が0.1μm以下である。

【0008】更に、本発明方法において、上記紫外線硬 化型インクの固形成分中の上記ITO微粒子の体積含有 率が50~80%である。

[0009]

20

【作用】本発明によれば、先ず透明導電膜を形成すべき ITOの超微粒子粉を用いてペースト状に形成したイン クをロールによって圧延することにより、ITO微粒子 を緻密化し、これにより形成された導電膜内のポイドの 発生を抑制することができる。又、かかるロールによる 圧延処理を行うことにより導電膜表面を平滑にし、この 結果、透明導電膜の光学的特性及び電気的特性の双方を 向上させることができる。紫外線硬化型インクを使用す ることにより、該インクを紫外線によって硬化せしめる 前に行われる上記圧延処理においてはかかる紫外線硬化 型インクが未だ硬化していない状態にあるため、圧延処 理時のロールの線圧力を比較的低く設定しても有効にI TO微粒子の緻密化を図ることができる。

【0010】又、本発明によれば、ITO微粒子の平均 粒径を 0.1μ m以下に設定することにより、ITOの 微粒子径を可視光線の波長以下にし、これにより、光の 散乱によって導電膜の光学的特性が損なわれるのを防止 することができる。

【0011】更に本発明によれば、基板に塗布される紫 外線硬化型インクの固形成分中のITO粒子の体積含有 率を特に50~80%に設定したことにより、導電膜の 40 電気的特性及び光学的特性を有効且つ大幅に向上させる ことができる。即ち上記圧延処理を行う際に緻密化され るITO粒子間の空隙を埋め尽くすだけの樹脂を必要と するが、この場合、ITO粒子の量が多過ぎると樹脂が かかる空隙を完全に埋めることができず、従ってポイド が発生して光線透過率及びヘーズ値が悪くなる上に、所 謂、ポーラスな導電膜になってしまいその強度が低下す る。一方、ITO粒子の量が少な過ぎるとかかるITO 粒子よりも過剰に存在する樹脂によってITO粒子同士 の相互接近が妨げられ、この場合には導電膜の光学的特

ない。従って、インクの固形成分中の樹脂とITO粒子 との含有割合を最適にする必要があるが、本発明方法に おいては、ITO粒子の体積含有率が上記のように50 ~80%に設定されている。

[0012]

【実施例】以下、本発明による透明導電膜の成膜方法の 一実施例を詳細に説明する。先ず基板である樹脂フィル ム上に塗布すべき紫外線硬化型インクの構成成分である ITOの超微粒子粉は、その平均粒径0.03μmのも のを用いる。そしてかかるITO超微粒子粉を、オリゴ マー及びモノマーから成る紫外線硬化型樹脂と混ぜ合わ せ、これら双方を合わせた重量に対して20%の溶剤を 添加して分散処理を行うことにより、紫外線硬化型イン クが形成される。尚、この紫外線硬化型インクにはこの 他に、重合反応を促進させるための光開始剤及び分散剤 等が含まれるが、上記オリゴマーとしての2官能基ウレ タンアクリレート, 上記モノマーとしての3官能基アク リレート(例えばトリメチロールプロパントリアクリレ ート)及び上記光開始剤としての380nm付近に吸収 領域を有する分子結合開裂型開始剤 (例えば1-ヒドロ キシシクロヘキサン) の重量比は60:35:5程度に 設定される。かかる紫外線硬化型インクの固形成分(樹 脂成分、ITO粒子、添加剤等)中のITO粒子の体積 含有率は50~80%程度であることが好ましいが、こ こでは50%、60%及び75%の3種類のインクを形 成した。

【0013】次に、上記3種類の紫外線硬化型インクの それぞれをスクリーン印刷法により基板樹脂フィルムの PETフィルム(厚さ100 umで、密着性を良好にす るためにプライマー処理が施されている)上に印刷し、 この後、赤外線加熱により80°Cの温度で30分間乾 燥せしめられる。そしてこの乾燥によって、紫外線硬化 型インク中に含まれている上記溶剤は揮発せしめられる が、この時点では紫外線硬化型インクの他の成分である オリゴマー及びモノマーが液状であるためPETフィル ム上に膜は未だ硬化してはいない。尚、上記3種類の紫 外線硬化型インクのいずれの場合も12cm×15cm 程度の広さの印刷領域を形成して行ったが、塗膜の厚さ はおよそ3 umである。

【0014】更に、基板樹脂フィルム上に上記スクリー ン印刷法によって釜布されたインクはスチールロールの よって圧延処理されるが、この圧延処理においてはその 表面がハードクロムメッキされた直径150mmの2本 のスチールロールを使用し、そも処理スピードが略10 cm/秒となるように該スチールロールの回転速度を設 定した。又、このスチールロールによる圧延処理を行う 場合、スチールロールの線圧力は100kgf/cm以 上であれば、必要且つ十分である。ここで、かかる線圧 力が高過ぎると基板樹脂フィルムに機械的歪みを生じて

されている。これは使用される基板樹脂フィルムの種 類、材質及び厚さ等に本実施例では上記設定値が好まし い。そして線圧力の上限は1000kgf/cm以下が 好ましい。

【0015】上記スチールロールによる圧延処理後、本 実施例のインクに対してはアルゴン等の不活性ガス雰囲 気中で紫外線硬化処理が行われる。即ち、基板樹脂フィ ルム上に塗布されている紫外線硬化型インクに対して、 高圧水銀ランプを用い室温下で10~120秒間、70 mW/cm²の照度の紫外線が照射される。ここで上記 のように不活性ガスを用いるのは、例えば空気中で紫外 線処理を行った場合には空気中の酸素が光開始剤から生 じたラジカルを消費してしまう所謂、酸素禁止作用によ り該光開始剤の重合反応が阻害されてしまうのを防ぐた めである。尚、酸素禁止作用は光開始剤や光開始助剤 (添加剤) 等の選択の仕方によりかなり改善されるが、 数μm程度の薄膜ではこの禁止作用を受けやすいので不 活性ガス中での硬化が好ましい。

【0016】本発明による透明導電膜の成膜方法は上記 のように構成されているから、先ず上記スチールロール による圧延処理を行うことにより、形成されたITO誘 明導電膜の光学的特性を著しく向上させることができ る。即ち、この圧延処理を施す前の状態の登膜の全光線 透過率は高々70%程度に過ぎなかったが圧延処理後は 80%以上にまで達し、又、導電膜のヘーズ値は20% 程度であったものが5%程度に向上した。この圧延処理 におけるスチールロールの線圧力は大きい程かかる効果 も大きくなるが、圧延処理時の処理温度は光学的特性に は殆ど影響を与えない。一方、圧延処理を施される紫外 線硬化型インクは通常、0~20%の溶剤を含んでいる が、基板樹脂フィルム上に印刷・乾燥後に脱溶剤化処理 が行われた後でも液状のオリゴマー及びモノマーが存在 しているために硬化していない。従ってこのような状態 で圧延処理が行われるので、スチールロールの線圧力を 比較的低く設定しても塗膜は容易且つ有効に圧延せしめ られITO粒子を容易に緻密化することができる。そし てこれにより導電膜表面が平滑化され、この点でも光学 的特性を向上させることができるが、一般の熱可塑性樹 脂を用いてインクを形成した場合には塗膜の圧延処理時 に300~500kgf/cm以上の高い線圧力が必要 になるのに比べて線圧力を低く設定することができると いう利点がある。このように線圧力を低くすることによ り基板樹脂フィルムの歪みの発生をなくすることができ

【0017】又、かかるスチールロールによる圧延処理 によりITO透明導電膜の電気的特性も向上させること できる。即ち、この圧延処理を施す前の状態の強膜の表 面抵抗は40~80kオーム/口にまで達していたが圧 延処理後は500~2500オームに低下している(図 しまうが、本発明ではかかる歪みが生じないように設定 50 1)。更に電気的特性としての表面抵抗は上記圧延処理 5

後に行われる紫外線硬化処理によって一旦、100~2 00オーム/口にまで低下するが、その後徐々に増加して300~500オーム/口で安定する(図4)。

【0018】次に本発明により形成されたITO透明導電膜の光学的特性及び電気的特性についての測定結果を図1乃至図4を参照して説明する。尚、これらの測定を行うに際してITO粒子の平均粒径は米国カウンタークローム社製のQuantasorb QS-10により、又、透明導電膜の全光線透過率及びヘーズ値は基板であるPETフィルムと一緒にスガ試験機株式会社製の直読ヘーズコンピュータHGM-ZDPにより、更に表面抵抗は上記PETフィルムを50mm×50mmの寸法に切り出した後三菱油化製のローレスタMCP-T400によりそれぞれ測定した。

【0019】図1及び図2はITO粒子の体積含有率を60%にした紫外線硬化型インクを用いてスチールロールによる圧延処理条件(温度,線圧力)を変化させて形成された紫外線硬化処理前のITO透明導電膜の表面抵抗値及び光学的特性(全光線透過率,へ一ズ値)についての測定結果を示している。尚、光学的特性は圧延処理 20温度の影響を殆ど受けないため図2では室温,50°C及び80°Cの3種類の温度データを一つにまとめて表した。この測定結果によれば圧延処理温度が室温及び5*

*0° Cの場合にはロール線圧力を高くすることにより表面抵抗値を500オーム/口以下になり(図1)、又、線圧力が100kgf/cm以上であれば良好な光学的特性が得られている。図3は圧延処理時の線圧力300kgf/cm、処理温度50° CにおいてITO粒子の体積含有率50%、60%及び75%の3種類の紫外線硬化型インクを用いて形成した紫外線硬化処理前のITO透明導電膜の光学的特性及び電気的特性の測定結果を示している。図から明らかなようにいずれの紫外線硬化型インクの場合にも良好な膜特性になっているが、この測定結果よりITO粒子の体積含有率は50~80%程度の範囲が光学的特性及び電気的特性を向上させる上で特に好ましい。

【0020】ここで、次の表1は紫外線硬化処理における雰囲気の種類と硬化作用との関係を示しており、この表1から明らかなように本実施例のインクに対してはアルゴン等の不活性ガスを用いることにより有効に紫外線硬化処理を行うことができる。尚、表1において硬化とは、塗膜をメチルエチルケトンを含ませた布で20回擦ったとき膜の剥離が生じない場合を意味する。又、インクを構成する樹脂の種類によっては空気雰囲気中においても有効に硬化せしめることができる。

【表1】

| | | 紫外線:高圧水銀ランプ, 70 mW/cm² 硬化時間 | | |
|---------|------|--------------------------------|--------------|------|
| | | | | |
| 硬化雰囲気 | アルゴン | 硬化 | 石 更 化 | 硬化 |
| | 空気 | 未硬化 | 未硬化 | 未硬化 |
| フィルムのそり | | なし | 少しあり | கிப் |

【0021】更に図4は紫外線硬化せしめられたITO 透明導電膜の経時変化の例を示しており、この例では30秒間の紫外線硬化処理により表面抵抗値は100オーム/□程度にまで低下するが、その後は徐々に増加して40数日後に略安定し、このように安定する表面抵抗値は紫外線硬化処理の前の状態の略1/2程度である。そしていずれの種類の導電膜の場合にもかかる紫外線硬化処理により表面抵抗値は40~70%程度にまで低下させることができる。尚、光学的特性については紫外線硬化処理によっても殆ど変化はない。

[0022]

【発明の効果】上述したように、本発明方法によればこの種導電膜の光学的特性及び電気的特性の双方を有効に向上させることができ、特に表面抵抗5001オーム/口 50

以下,全光線透過率80%以上及びヘーズ値10%以下である耐溶剤性に優れたITO透明導電膜を形成することができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法により形成した紫外線硬化処理前の ITO透明導電膜の電気的特性と圧延処理条件との関係 を示すグラフである。

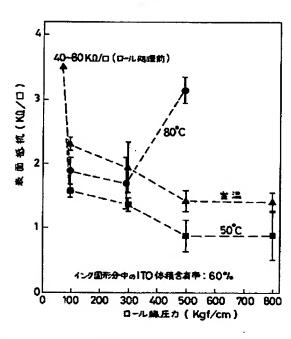
【図2】本発明方法により形成した紫外線硬化処理前の ITO透明導電膜の光学的特性と圧延処理条件との関係 を示すグラフである。

【図3】本発明方法により3種類の紫外線硬化型インクを用いて形成した紫外線硬化処理前のITO透明導電膜の光学的特性及び電気的特性の測定結果を示すグラフである。

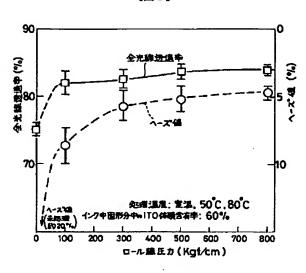
【図4】本発明方法により形成したITO透明導電膜の

表面抵抗の経時変化の例を示したグラフである。

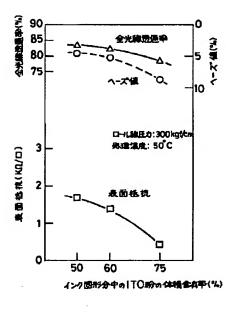
[図1]



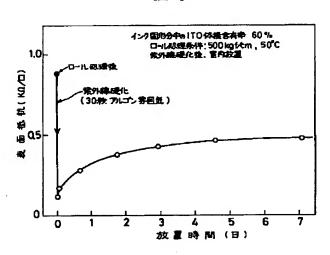
[図2]



【図3】



【図4】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ CRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY